МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2026/2027 навчальний рік, прийому здобувачів 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
Тетяна ЖЕЛЯСКОВА
"31" 08 2026 р.

Спеціальність	176 Мікро- та наносистемна техніка	Факультет/ННІ	Факультет електроніки
Освітня програма	Електронні мікро- і наносистеми та технології	Форма здобуття вищої освіти	*Очна (денна)*
Освітній ступінь	бакалавра	Строк навчання	3 роки 10 місяців
Випускова кафедра	*Кафедра електронної інженерії*	Кваліфікація	бакалавр з мікро- та наносистемної техніки

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув. Бюджет	К-ть здобув. Контракт	Обсяг дисциплін Кред ECTS	Обсяг дисциплін Години	Аудиторні години Всього	Лекції за НП	Лекції з урах. Інд занять	Практ. (комп. прк) за НП	Практ. (комп. прк) з урах. Інд занять	Лабор за НП	Лабор з урах. Інд занять	Інд. зан.	СРС	Контрольні заходи Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами: 4 курс; ДМ-31 (Б: 7, К: 2); ДМ-32 (Б: 0, К: 0); 7 семестр: 15 тижнів: Всього	у т.ч. Лекц	у т.ч. Практ	у т.ч. Лаб	8 семестр: 9 тижнів: Всього	у т.ч. Лекц	у т.ч. Практ	у т.ч. Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																														
	Цикл загальної підготовки																														
1	*Економіка і організація виробництва*	ЕК	7	2	4.0	120	72	36	-	36	-	-	-	0	48		7	7						4.8	2.4	2.4					
2	*Охорона праці та цивільний захист*	ОПЦБ	7	2	4.0	120	72	36	-	28	-	8	-	0	48		7	7						4.8	2.4	1.87	0.53				
3	*Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2*	АМТС1	7	2	3	90	54	-	-	54	-	-	-	0	36	8		7						2.4		2.4		2		2	
	Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки				11	330	198	72	0	118	0	8	0	0	132	1	2	3	0	0	0	0	0	12	4.8	6.67	0.53	2	0	2	0
	Цикл професійної підготовки																														
4	*Схемотехніка. Частина 2. Цифрова схемотехніка*	ЕІ	7	2	7.5	225	108	54	-	18	-	36	-	0	117	7		7						7.2	3.6	1.2	2.4				
5	*Схемотехніка. Курсовий проект*	ЕІ	7	2	1.5	45	0	-	-	-	-	-	-	0	45		7			7											
6	*Переддипломна практика* †	ЕІ	7	2	6.0	180	0	-	-	-	-	-	-	0	180		8														
7	*Дипломне проєктування*	ЕІ	7	2	6.0	180	0	-	-	-	-	-	-	0	180																
	Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки				21	630	108	54	0	18	0	36	0	0	522	1	2	1	0	1	0	0	0	7.2	3.6	1.2	2.4	0	0	0	0
	ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ				32	960	306	126	0	136	0	44	0	0	654	2	4	4	0	1	0	0	0	19.2	8.4	7.87	2.93	2	0	2	0
	2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																														
	Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																														
8	*Оптоелектроніка* ‡	МЕ	7	2	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66		8	8					8					6	4		2
9	*Мікрохвильова техніка* ‡	ЕІ	7	2	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66		8	8			8							6	4		2
10	*Телеметричні системи* ‡	ЕІ	7	2	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		8	8					8					6	4	2	
11	*Основи конструювання біомедичної апаратури-2* ‡	ЕІ	7	2	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66		8	8					8					6	4		2
12	*Основи конструювання біомедичної апаратури-1* ‡	ЕПС	7	2	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66		7	7				7		3.6	2.4		1.2				
13	*Інформаційні технології проектування у мікро- і наносистемах* ‡	ЕІ	3	2	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66		7	7				7		3.6	2.4		1.2				
14	*Функціональні пристрої для обробки інформації* ‡	МЕ	6	1	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66		7	7				7		3.6	2.4		1.2				
15	*Мікроконтролери* ‡	МЕ	5	1	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		7	7				7		3.6	2.4	1.2					
	Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки				28	840	378	252	0	126	0	0	0	0	462	0	7	7	0	0	3	3	1	10.8	7.2	3.6	0	24	16	8	0
	ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ				28	840	378	252	0	126	0	0	0	0	462	0	7	7	0	0	3	3	1	10.8	7.2	3.6	0	24	16	8	0
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:				60	1800	684	378	0	262	0	44	0	0	1116	2	11	11	0	1	3	3	1	30	15.6	11.47	2.93	26	16	10	0

† Опанування освітнього компонента здійснюється на підприємстві
‡ Виконано перерозподіл аудиторних годин

Реєстраційний номер РНП: 9419

Військова підготовка у 5 - 8 семестрах за окремим планом військової підготовки

Кількість								
Кількість екзаменів	2	1			1			
Кількість заліків	11		6			5		
МКР	11			7			4	
Курсових робіт	0							
Курсових проєктів	1	1						
РГР, РР, ГР	3		1			2		
ДКР	3			2			1	
Рефератів	1							1

ПРАКТИКА

Назва практики	Термін проведення	Тижні	Семестр
Переддипломна практика	2027-04-19 - 2027-05-16	4	8

АТЕСТАЦІЯ

Форма випускної атестації	Термін проведення
Захист кваліфікаційної роботи	2027-06-14 - 2027-06-30

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ (РОБОТИ)

Вид роботи	Норма в годинах на 1 здобувача	Кафедра	Кількість здобувачів Б	Кількість здобувачів К	Всього годин Б	Всього годин К
Керівництво	21	КЕІМБМЕ	7	2	147	42
Рецензування	2	МЕ	7	2	14	4
ЕК	2	КЕІМБМЕ	7	2	14	4
Всього годин	25	Всього годин			175	50

Ухвалено на засіданні Вченої ради ФЕЛ ПРОТОКОЛ № 04/2026 від 2026-04-20

Завідувач кафедри ЕІ Катерина ІВАНЬКО (підпис)

Декан факультету (директор інституту) Сергій НАЙДА (підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;